**細生所電子顯微設施 樣品處理申請單**

ICOB EM core Service Request Form

2024年01月製表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位名稱Institute |  | 單位主管/指導教授(PI) |  |
| 服務申請者User |  | 電話Tel |  | 電子信箱E-mail |  |
| 樣品資訊Sample | 名稱: |
| 研究目的Research purposes |  |
| 申請服務項目 | □切超薄切片;數量\_\_\_\_\_ □製作支持膜□常溫 □低溫 □高壓冷凍樣品處理TEM樣品處理(固定🡪脫水🡪包埋🡪切片🡪染色) □形態觀察　□負染色處理　□免疫金染色觀察□SEM樣品前處理(固定🡪脫水) | 處理費用: (院內外學術單位)TEM常溫樣品製備1500 /sample超薄切片2000/sample免疫金染色 1500/sample負染300/sampleSEM樣品製備1000/sample臨界點乾燥300/次 鍍金500/次 |
| 樣品收件日期: 電顯室簽收: 切片預計完成日期: 申請者確認: 上機日期: (申請者自行上網預約－院內IIS預約系統) |

**【注意事項】**

1. 樣品處理以本實驗室標準程序操作。
2. 技術員會評估樣本處理的時間，告知申請者切片預計完成日期。
3. 若未達預期結果，設施將提供可能因素及改善方法予申請者參考。
4. 費用將於每月10日前由院內PI轉帳扣款。
5. 若您的研究有使用到本設施服務，請於誌謝欄提及本設施名稱及計畫編號。以下致謝範例供參。

Acknowledgment

We thank Academia Sinica Biological Electron Microscopy Core Facility for EM technical support. The core facility is funded by Academia Sinica Core Facility and Innovative Instrument Project (AS-CFII-111-203)

**若同意以上事項，請於下方簽名**

**單位主管/指導教授(PI): 日期(date)**

**服務申請者(User): 日期(date)**